

装置・技術担当者一覧（2024年度版）

総責任者： 入船 徹男				
I. 超高压装置群（超高压実験装置と関連装置）				
	[通称]	[装置型番]	[管理・実施責任者]	
(1)	マルチアンビル超高压発生装置	Orange-1000		西原遊, 新名亨
(2)	マルチアンビル超高压発生装置	Orange-3000		大内智博, Steeve Gréaux, 新名亨
(3)	D-DIA型超高压変形装置	Madonna I		大内智博, 西原遊, 新名亨
(4)	DIA型焼結ダイヤモンドアンビル超高压装置	Madonna II		新名亨, 大内智博
(5)	ダイヤモンドアンビルセル	DAC		境毅
(6)	DAC用ファイバーレーザー加熱システム	Fiber laser		境毅
(7)	DAC用CO ₂ レーザー加熱システム	CO ₂ laser		境毅
(8)	マルチアンビル装置用高圧下弾性波速度測定装置	Ultrasonic	TDS5104	Steeve Gréaux
II. 微小試料分析装置（電子顕微鏡および関連装置とX線回折・分光装置等）				
(9)	電界放出型電子プローブ微小分析器	FE-EPMA	JXA-IHP200F	桑原秀治, 大内智博
(10a)	電界放出型走査電子顕微鏡（EDS付き）	FE-SEM-EDS	JSM-IT500HR	大内智博, 桑原秀治
(10b)	電界放出型走査電子顕微鏡（EBSD付き）	FE-SEM-EBSD	JSM-IT500HR	大内智博, 桑原秀治
(11)	走査型電子顕微鏡（EDS付き）	SEM-EDS	JSM-6510LV	大内智博, 桑原秀治
(12)	分析透過型電子顕微鏡（電界放出型）	FE-TEM	JEM-2100F	井上紗綾子, 大内智博
(13)	透過型電子顕微鏡（熱電子銃型）	TEM	JEM-2010	井上紗綾子, 大内智博
(14)	集束イオンビーム（デュアルビーム）加工装置①	Dual Beam FIB (1)	Scios	境毅, 井上紗綾子
(15)	集束イオンビーム（デュアルビーム）加工装置②	Dual Beam FIB (2)	Scios2	井上紗綾子, 境毅
(16)	微小領域X線回折装置	Micro-focus XRD	RAPIDII-V/DW	境毅, 新名亨, 桑原秀治
(17)	粉末X線回折装置	Powder XRD	UltimaIV/DD	新名亨, 桑原秀治
(18)	顕微ラマン分光装置①（日本分光）	Micro-Raman Spectroscopy	NRS-5100gr	境毅, 桑原秀治, 新名亨
(19)	顕微ラマン分光装置②（Photon Design）	Micro-Raman Spectroscopy	RSM 800	境毅, 新名亨
(20)	顕微近赤外レーザーラマン分光装置	Micro-Raman (NIR) Spectroscopy	NRS-4500	境毅, 桑原秀治, 新名亨
(21)	顕微赤外分光装置	FT-IR	IRT-5200EUO	西原遊, 新名亨
(22)	紫外可視近赤外分光システム	UV-Vis-NIR	V-670	新名亨
(23)	レーザー顕微鏡	Laser microscope	OPTELICS HYBRID L3	新名亨
(24)	イオン研磨加工装置①（イオンスライサ）	Ion Slicer	EM-09100 IS	井上紗綾子, 大内智博
(25)	イオン研磨加工装置②（アルゴンイオンミリング）	PIPS	Model 691	井上紗綾子, 大内智博
	白金・金・カーボン蒸着装置	Coater	Neoc-STB/JFC-1600/JEC-560	大内智博, 桑原秀治
III. 加工装置・その他の特徴ある装置				
(26)	超音波加工機		UM-150CS	西原遊, 大内智博
(27)	自動パーツ加工機①		MDX-540	新名亨, Steeve Gréaux
	自動パーツ加工機②		MDX-40a	西原遊, 新名亨, Steeve Gréaux
(28)	高温雰囲気炉①	大型炉	ATCM50-100/1700	西原遊, 新名亨
(29)	高温雰囲気炉②	小型炉	TS-4B06	西原遊, 新名亨
(30)	マイクロピッカース硬度計		HMV-G21DT	新名亨
	大型平面研磨盤		GS-BMHF	新名亨, Steeve Gréaux, 桑原秀治
	精密ボール盤		JIG-3M-1	西原遊, 新名亨, 大内智博
	コンターマシン		V-33	西原遊, 新名亨
	自動研磨機		EcoMet3000	西原遊, 新名亨
	ファイバーレーザー加工装置①	DAC用	FL-LM 01	境毅, 新名亨
	ファイバーレーザー加工装置②	MA用	ML-7111A	西原遊, 新名亨
	ダイヤモンド研磨機		MCBS-320	入船徹男, 新名亨
	大型NCタッピング装置		MTV-T310; KIRA, PCV-30	新名亨
	CCD形状観察装置（キーエンス）		VHX-2000	新名亨
	デジタルマイクロスコープ（ライカ）		DVM6	新名亨
	炉床昇降式高温電気炉		SPM65-17	Steeve Gréaux
IV. 数値計算用コード				
(31)	鉱物物性シミュレーションコード			土屋卓久, 出倉春彦
(32)	数値流体シミュレーションコード			亀山真典
V. センター外設置装置・技術				
(33)	変形機構付きガイドブロック（SPring-8 BL04B1 ビームライン）	D-DIA型・D111型		西原遊, 大内智博
(34)	X線その場観察弾性波速度測定装置（SPring-8 BL04B1 ビームライン）			Steeve Gréaux
	高速度カメラ（SPring-8 BL04B1 ビームライン）		FASTCAM Mini AX100	Steeve Gréaux
VI. センター合成のナノ多結晶ダイヤモンド（ヒメダイヤ）				
	各種の応用研究用としてヒメダイヤの合成ならびに最適加工	NPD		入船徹男, 新名亨